

## MT-200/300/400 微分干涉工具显微镜



### 性能特点

- 创新图像处理技术，获得更精细的动态图像，测量数据直接发送至 AutoCAD 中，测量数据及时传输到 Word/Excel，以便实时分析，强大的元素测量功能。
- 全新的光路设计无限远校正光学系统，光效率更高，采用长寿命 LED 光源，提供出色的图像质量。

### 技术参数

配置		MT-200	MT-300	MT-400
测量范围 (mm)	X	200	300	400
	Y	100	200	300
	Z	150	150	150
工作台 (mm)	铝合金台面	350*250	500 *350	600*500
	玻璃台面	250*150	350*250	450*350
	承重	15Kg		
影像及 测量系统	CCD	美国 TEO 1/2" 高分辨率彩色相机		
	光学系统	无限远色差校正光学系统		
	三目观察筒	三目观察筒 (分光比 50 : 50) , 1XCTV 接口		
	目镜	PL10X/22 平场高眼点目镜 (其中 1 只十字)		
	物镜	5X 物镜 (明场无限远, DIC) , 5X/0.13 WD10.8mm 10X 物镜 (明场无限远, DIC) , 10X/0.25 WD10.0mm		

		20X 物镜 ( 明场无限远 , DIC ) , 20X/0.40 WD4.0mm
		50X 物镜 ( 明场无限远 ) , 50X/0.55 WD7.9mm
显示分辨率		0.001mm
测量精度	X/Y 轴	( 3+L/200 ) um
	Z 轴(选配)	( 5+L/200 ) um
	重 复 性	2um
调焦系统	手 动	Z 轴行程 150mm , 粗微同轴 , 最小调节精度 2um
照明系统		反射 : 柯勒照明系统 , 24V/150W 钨钨冷光源
		透射 : 5W 白色 LED ,
微分干涉装置		DIC 微分干涉组件 ( 反射光用 ) , 含直偏、检偏器
台式电脑		2G/500G/DVD/键鼠/+19 液晶显示器
测量软件		二维几何量测量功能主要包括 : 两点间距离、点到直线的距离、角度、圆心距 ; 十字线显示 ,
校正片		0.01mm
电 源		90 ~ 240V 电压 , 50HZ
仪器重量		320Kg、
可供附件		0.5X CTV 接口
		DIC 微分干涉片
		100X 物镜 ( 明场无限远 ) , 100X/0.80 WD2.1mm 选配

本文资料来源苏州欧米特: <http://www.oumit.net/>